

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005年1月27日 (27.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/008853 A1

(51) 国際特許分類<sup>7</sup>: H01T 4/12

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/009958

(22) 国際出願日: 2004年7月13日 (13.07.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願2003-198667 2003年7月17日 (17.07.2003) JP  
特願2004-065728 2004年3月9日 (09.03.2004) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 三菱マテリアル株式会社 (MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008117 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 社藤 康弘 (SHATO, Yasuhiro) [JP/JP]; 〒3688502 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 Saitama (JP). 尾木 剛

(OGI, Tsuyoshi) [JP/JP]; 〒3688502 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 Saitama (JP). 足立 美紀 (ADACHI, Miaki) [JP/JP]; 〒3110102 茨城県那珂郡那珂町向山1002-14 Ibaraki (JP). 李 成圭 (LEE, Sung-gyoo) [JP/JP]; 〒3110102 茨城県那珂郡那珂町向山1002-14 Ibaraki (JP). 栗原 駿 (KURIHARA, Takashi) [JP/JP]; 〒3688502 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 Saitama (JP). 植田 稔晃 (UEDA, Toshiaki) [JP/JP]; 〒3110102 茨城県那珂郡那珂町向山1002-14 Ibaraki (JP).

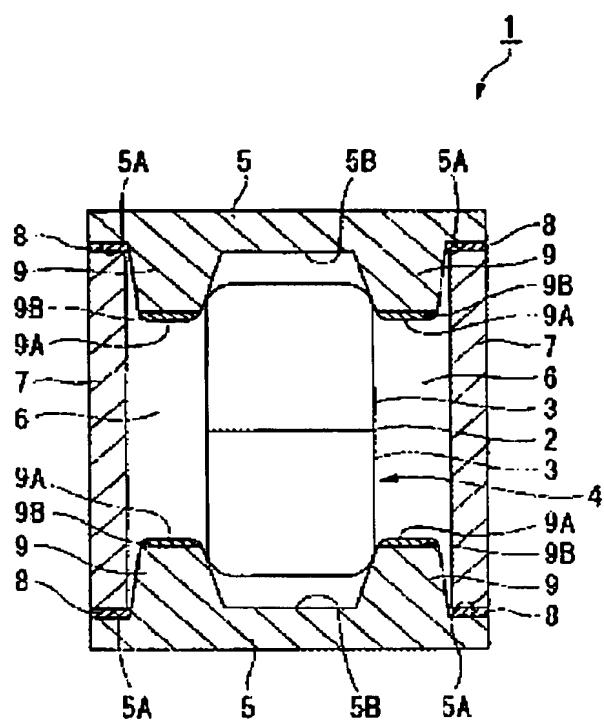
(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

/統葉有/

(54) Title: SURGE ABSORBER

(54) 発明の名称: サージアブソーバ



(57) Abstract: A surge absorber in which an oxide layer excellent in chemical stability in the high temperature range and excellent in adhesion to main discharge electrodes is deposited on the main discharge electrodes. The surge absorber comprises a cylindrical ceramic body (4) on which conductive films (3) separated by a discharge gap (2) are formed, a pair of main discharge electrode members (5) opposingly disposed at both ends of the cylindrical ceramic body (4) and in contact with the conductive films (3), and a tubular ceramic body (7) in which the paired main discharge electrode members (5) are opposed, the cylindrical ceramic body (4) is contained, and a filling gas (6) is sealed. Each of the paired main discharge electrode members (5) has a projecting support (9). The opposed surfaces of the projecting supports (9) serve as main discharge surfaces (9A). Oxide films (9B) are formed on the main discharge surfaces (9A) by oxidation.

(57) 要約: 高温領域で化学的安定性に優れ、かつ主放電電極に対する付着力の優れた酸化物層が被覆されたサージアブソーバを提供すること。放電ギャップ2を介して導電性被膜3が分割形成された円柱状セラミックス4と、円柱状セラミックス4の両端に対向配置され導電性被膜3に接触する一对の主放電電極部材5と、一对の主放電電極部材5を対向するように配して円柱状セラミックス4を内部に封止ガス6と共に封止する筒型セラミックス7とを備え、一对の主放電電極部材5の少なくとも突出支持部9の対向する面である主放電面9Aに酸化処理による酸化膜9Bが形成されている。

WO 2005/008853 A1



SI, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,  
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,  
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,  
IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SI, SK, TR), OAPI (BJ,  
BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,  
TD, TG).

添付公開書類:  
— 國際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。